

初心者歓迎



川崎市

「ナノファブスクエア」開催案内

新川崎・創造のもりのNANOBI Cオープンラボ
ナノ・マイクロ技術講習・実習会

回	プロセス	実習で利用する装置(材料)	日程
1	超解像度レーザー顕微鏡	超解像度レーザー顕微鏡	2018/5/17(木)
2	フォトマスク作製	レーザ描画装置	5/31(木)
3	精密リソグラフィ	両面マスクアライナ	6/28(木)
4	加工表面観察	超高解像度表面形状計測装置、触針式段差計	7/12(木)
5	シリコンドライエッチング	シリコン深堀りDRIE装置	7/27(金)
6	レジスト塗布	コータデベロッパ装置、スピンコータ	8/8(水)
7	マイクロモールドイング	レーザ描画装置	8/30(木)
8	ガラスエッチング	高密度プラズマドライエッチング装置	9/20(木)
9	金属薄膜形成(1)	ECR スパッタ	10/4(木)
10	パリレン薄膜形成	パリレン蒸着装置	10/25(木)
11	金属薄膜形成(2)	4元マグネトロンサイドスパッタ	11/8(木)
12	ウェットエッチング	ドラフト	11/15(木)
13	ウェーハ切断	ダイシングソー	11/22(木)
14	デバイス接合	プラズマ発生装置	仮 12/6(木)
15	3次元加工構造観察	レーザ顕微鏡、3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡	仮 12/20(木)

場所

かわさき新産業創造センター (KBIC)新館 NANOBI C
川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり (JR新川崎駅から徒歩10分)

実習概要

マイクロ流路の一連の試作を、シリコン、ガラス、樹脂を使い実施し、表面形態の観察・評価までを行うプログラムにより、目的に応じた受講が可能です

主催：4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアム
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)、川崎市

共催：次世代マイクロ化学チップコンソーシアム

定員：5名程度(先着) 費用：原則実費(個別チラシに費用を掲載)を負担いただきます。

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムでは、産学連携による技術や産業の創出に寄与するため、川崎市、KISTECと連携し、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBI C」において、4大学の先端機器の開放利用を行っています。今後、4大学の機器を更に効果的にご利用いただくため、企業や大学の方を対象としたナノ・マイクロ技術講習・実習会『ナノファブスクエア』の個別チラシを順次掲載し開催して参りますのでご参加ください(NANOBI Cオープンラボホームページ <http://open-labo.skr.jp/>)。

「NANOBI Cオープンラボ」
ホームページに随時掲載、
開放利用機器の詳細仕様は
機器一覧をご覧ください。



問合せ窓口：唐澤志郎 Tel: 080-6560-3061 / E-mail: karasawa@newkast.or.jp
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所
※川崎市中小企業は、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金をご利用できます
(URL: <http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000085717.html>)のご相談ください。